

2015年1月吉日

各位

公益社団法人 日本表面科学会
会長 尾嶋 正治

日本表面科学会主催「实用顕微評価技術セミナー2015」
発表・展示のご協力お願い

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素は日本表面科学会の活動にご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて当学会では、ナノ材料・デバイスの評価技術として重要な電子顕微鏡・走査プローブ顕微鏡を軸に、関連する新しい顕微評価技術の展開と促進を図り、産業界への貢献に努めたいと考えております。これまで装置メーカーや分析会社のご協力による最新の評価技術の紹介と、ユーザーからの意見や要望を提示していただく場を提供するため、表記の实用顕微評価技術セミナーを2013年1月、2014年6月の2回にわたって東京で開催いたしました。いずれもお蔭様で約20社の出展ご協力のもと延べ300名以上のご来場者の中で活発な情報交換がなされました。そこで今後もこれら顕微評価技術のさらなる普及と新たなニーズの掘り起こしのため当学会としても本セミナー開催を継続したく、来年度も下記のとおり各位のご協力を得てポスター展示を中心とした企画を実施することにいたしました。どうか本セミナーの開催に対するご理解と運営へのご支援を賜りたく、発表展示への参加申し込みにご協力をお願い申し上げます。なお、今回はプログラムをできるだけ早急に確定して集客に臨みたく、発表展示の申込み締め切りを以前より早めておりますので、これについてもご理解のほどお願いいたします。

敬具

記

1. 開催要項

- (1) 開催日時 2015年 6月 19日 (金)
- (2) 場所 東京大学 小柴ホール (東大本郷キャンパス・理学部1号館内)
- (3) 時間 10:00～17:30 (予定)
- (4) 聴講者参加費 無料
- (5) 企画運営 日本表面科学会 産業連携委員会・企画委員会・関東支部

2. 発表・展示要領

- (1) 発表・展示時間
 - ・ショートプレゼンテーション：10分/件
 - ・ポスター展示説明：午前は昼食休憩を含めた約1.5時間と、午後はショートプレゼンテーション後の2回で、計3回 (3時間程度)
 - *上記時間は、発表件数により多少の変更が生じる場合があります。
 - (ご参考までに、次頁に前回セミナーのプログラムを示します。)
 - *あくまで学会主催のセミナーですので、製品紹介のみのプレゼンテーション (セールストーク) とならないようご配慮下さい。
 - *ポスター展示会場には、ボード1枚と机1つを準備致します。
- (2) 発表・展示参加費
 - A. ショートプレゼンテーション・ポスター展示、広告
維持会員・賛助会員：40,000円、一般企業：50,000円

B. 広告のみ

維持会員・賛助会員：30,000円、一般企業：40,000円

*テキストに掲載する発表用資料、および広告の原稿を予めご提出頂きます。

テキストに掲載できる発表用スライドは12枚まで（“2 in 1”形式で6ページ以内）、
 広告(A4サイズ)は4ページ以内の計10ページ以内(広告のみの場合は4ページ以内)、
 いずれもモノクロ印刷とします。

(3) 申し込み方法

- ・ポスター展示等にご協力頂ける場合は、添付の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、e-mailにファイルを添付してお申し込み下さい。
- ・発表用資料原稿はPPTファイル形式で、広告原稿はPDFなどの電子ファイルにて提出下さい。

*申し込み・原稿提出先：

日本表面科学会産業連携委員会委員 加連明也（物質・材料研究機構）

E-mail: KAREN.Akiya@nims.go.jp

*申し込み締め切り 2015年 2月27日（金）

*原稿提出締め切り 2015年 5月18日（月）

3. その他

セミナー終了後に、発表・展示各社の交流を目的に簡単な交流会（無料）を開催することを計画しています。

（ご参考）前回セミナー[実用顕微評価技術セミナー2014]プログラム

時間	会社名	発表タイトル	発表者(敬称略)
10:00~		開会の挨拶	
10:10~10:20	(株)日立ハイテクノロジーズ	最新型FE-SEMIによる極表面(nmオーダー)評価事例の御紹介	立花 繁明
10:20~10:30	(株)日立ハイテクサイエンス	収束イオンビーム装置(FIB/FIB-SEM)による三次元解析事例の紹介	中谷 郁子
10:30~10:40	(株)東陽テクニカ	SEMIにおける二次電子(SE)と反射電子(BSE)の信号分離	橋本 拓
10:40~10:50	日本電子(株)	表面解析の為に試料断面作製装置 CrossSectionPolisher	小倉 一道
10:50~11:00	(株)コベルコ科研	球面収差補正STEMを用いた機能性材料の原子分解能解析	石丸 雅大
11:00~11:10	(独)物質・材料研究機構	走査型ヘリウムイオン顕微鏡によるナノスケール観察・加工とその共用	大西 桂子
11:10~11:20	アルバック・ファイ(株)	最新TOF-SIMSによるナノ・イメージング分析	眞田 則明
11:20~11:30	東芝アナリティクス(株)	3次元アトムプローブを用いたLED解析	内田 博
11:30~11:40	アメテック(株)	3次元アトムプローブLEAP4000Xのご紹介	石川 真起志
11:40~13:00	昼食/ポスターセッション・展示		
13:00~13:50	特別講演「走査プローブ顕微鏡の現在、過去、未来」 長谷川 修司 先生(東大)		
13:50~14:00	(株)島津製作所	高分解能SPM(HR-SPM)による最新の顕微評価技術	粉川良平
14:00~14:10	(株)アドバンスアルゴリズムシステムズ	SPMシミュレータのご紹介 ~DFTB法に基づいたシミュレーション計算~	小方 亨
14:10~14:20	(株)アドバンスアルゴリズムシステムズ	試料-探針間の粘弾性接触を考慮した液中AFMシミュレーション	香妻 広夫
14:20~14:30	(株)テックサイエンス	ナノテク教育用コンパクト一体型SPMのご案内	三塚 公子
14:30~14:40	日本カンタム・デザイン(株)	“No Scanning”測定が可能にする新しい表面形状解析 ~濡れ、乾燥などの表面形状変化やMEMSなどの3Dその場観察/解析~	片倉 大輔
14:40~14:50	日本カンタム・デザイン(株)	“分光測定+AFM”の融合から生まれる微細局所の多角分析と高分解能解析	片倉 大輔
14:50~15:50	休憩/ポスターセッション・展示		
15:50~16:00	オミクロン ナノテクノロジー ジャパン(株)	新商品Fermi SPMの紹介	富塚 仁
16:00~16:10	(株)ユニソク	ユニソクの新技术のご紹介	小澤 太健展
16:10~16:20	レニショー(株)	最速2D/3Dラマンイメージングのご紹介	三澤 真弓
16:20~16:30	WITec (株)	「AFM/SEM+ラマン」という提案~表面形状と化学特性から広がる試料評価	中本 圭一
16:30~16:40	(株)日本サーマル・コンサルティング	100ナノメーター以下分解能で赤外分光分析を実現するAFM-IR測定法	浦山 憲雄
16:40~17:10	ポスターセッション・展示		

実用顕微評価技術セミナー2015 参加申し込み

(このページのみ、e-mailに添付して下さい。)

申込み者:

氏名(ふりがな)	
会社名	
所属	
住所	
TEL	
E-mail	
参加区分(参加費)	ショートプレゼンテーション・ポスター展示・広告に参加 <input type="checkbox"/> 維持会員・賛助会員(40,000円) <input type="checkbox"/> 一般(50,000円)
該当の□を■にして下さい	広告のみに参加 <input type="checkbox"/> 維持会員・賛助会員(30,000円) <input type="checkbox"/> 一般(40,000円)

発表(ショートプレゼンテーション・ポスター)タイトル:

--

発表者:(申込み者と同じ場合は記入不要)

氏名(ふりがな)	
会社名	
所属	
住所	
TEL	
E-mail	

ご意見など:

--

以上